

ウエーハバキュームシステム

水封式真空発生装置 Model: WVC-750

1.開発目的

半導体電子部品用に用いられるウエーハ基板をクランプする為に開発した水封式真空発生装置です。従来の真空発生装置は到達真空が弱かったり、コンタミネーションに弱かったりとさまざまな問題点がありました。

本水封式真空発生装置はその弱点を極限までおさえ、到達真空度においては $5.3\text{Pa} \times 10^3$ にまで達成し、強い真空度とコンタミネーション及び水分を含んでも故障しない特徴を持った装置です。装置との連結だけでクーリングタワーやエ水配管に接続することなく、周辺ユーティリティの心配がいない独立型の水封式真空発生装置です。

2.用途

- 半導体製造装置全般
- 研削盤/ラップ/ポリッシング装置用 ウエーハバキュームチャック
- 測定機ワーククランプ用 ウエーハの吸着/搬送、真空ピンセット
- 工作機械のバキュームチャック用

3.特徴

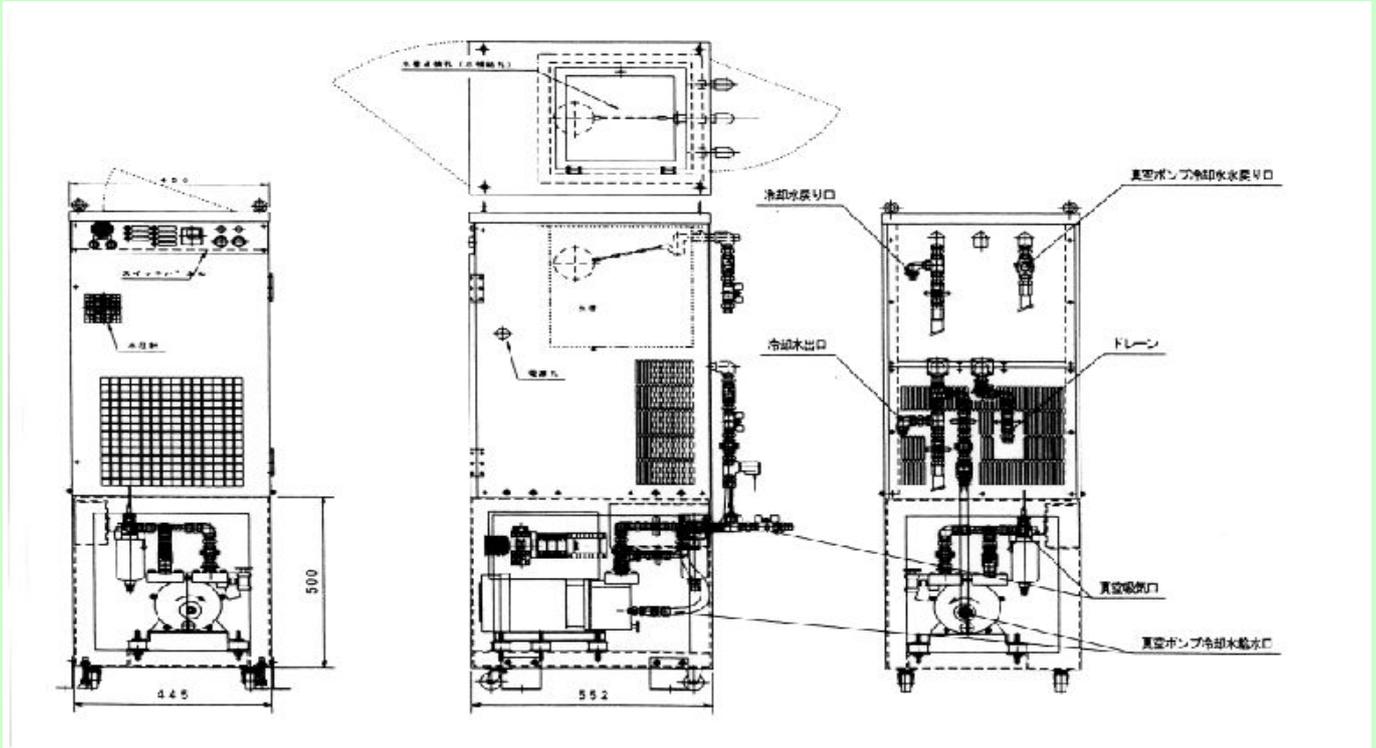
- 水蒸気や水滴を含んだ気体のバキュームに最適！
- 低騒音で振動が少なく長時間安定真空実現
- 水循環冷却による水の消費量節約
- 水冷循環チラーと一体化して使用可能
- 強いバキューム力($5.3\text{Pa} \times 10^3$ を達成)

株式会社 フェムテック

〒116-0013 東京都荒川区西日暮里2-50-5

TEL:03-5615-3232 FAX:03-5615-3233

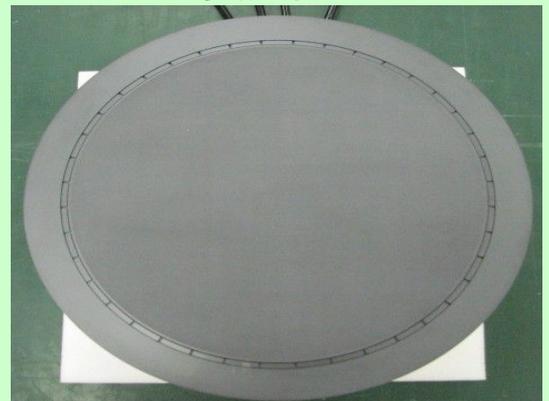
■概略図



■仕様

型式名	WVC-750
運転制御	PID(ON,OFFコントロール)
真空方式	水封式真空ポンプ方式
真空到達圧力	$5.3\text{Pa} \times 10^3$
排気速度	$17 \sim 20\text{m}^3/\text{hr}$
給水量(循環)	$3 \sim 5\text{l}/\text{min}$
水供給方法	純水循環冷却方式
純水タンク	26ℓ
タンク材質	SUS304
冷却能力	$20\text{kW}/1720\text{kcal}/\text{hr}$
水温設定管理	$18^\circ\text{C} \sim 20^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$
電源	AC200V 3相 50H/60H
消費電力	25kw
外形寸法	W450mm × D700mm × H1400mm
重量	約130kg

＜実用例＞



炭化珪素製SiCピンチャック



Φ300mmウエーハ吸着状態

株式会社 フェムテック